

专著信息

书名	Microstructural characterization of low dielectric silica xerogel film
语种	英文
撰写或编译	
作者	Z.W.He,C.M.Zhen,X.Q.Liu,W.lan,Y.Y Wang
第一作者单位	
出版社	Thin Solid Films 202-263,168-171 (2004)
出版地	
出版日期	2004年 月 日
标准书号	
介质类型	
页数	
字数	
开本	
相关项目	超低介电常数纳米多孔薄膜材料的制备和特性研究